

ナノ・マイクロビジネス展【終了】

弊社は、2015年4月22日(水)よりパシフィコ横浜にて開催された「ナノ・マイクロビジネス展」に出展いたしました。

弊社ブースにご来場いただきありがとうございました。

展示会概要

開催期間

2015年4月22日(水)～4月24日(金)

10:00～17:00

展示会場

パシフィコ横浜 展示ホールB

ブース番号

D-4

展示内容

小型電子部品(MEMSデバイス、水晶振動子、半導体パッケージ等)向けの気密検査装置を実演・展示いたします。

セミナー

題目 「MEMSパッケージリークテストの最新技術と動向」

場所 展示ホールB プレゼンテーションルーム

日時 4月24日(金) 13:30～13:50

内容(予定)

- ・漏れ試験の現状やフクダの取り組み
- ・MEMS向けリークテスト装置 $4 \times 10^{-15} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}(\text{He})$ のご紹介

同時開催展

OPIE'15(レーザーと光学技術の総合展示会)

展示会公式サイト

<http://www.micromachine.jp/>

nanomicro biz
ROBOTECH

FUKUDA CO., LTD.
2015.4.22～2015.4.24

出展製品

エアリークテスタ FL-611 series

- ・空気の圧力変化を利用した差圧式エアリークテスタ
- ・汎用性が高く、量産設備に最適
- ・マスタ無し測定が可能

対象ワーク

エンジン部品、ミッション部品、燃料系部品、
ブレーキ部品、バッテリー、熱交換器、エアコン、
リチウムイオン二次電池、FCセル、FCモジュール、FCタンクなど



水素リークディテクター HD-111 series

- ・付属プローブにより、漏れ箇所の特定に最適
- ・水素5%+窒素95%のトレーサガスを使用し安全

対象ワーク

インバータ、コンバータ、ハーネス、バッテリーケース、
二次電池、FCセル、FCモジュール、FCタンク、
スマートフォン(漏れ箇所)など



小型電子部品専用気密検査装置 MSX-0100 series

- ・密封製品の少量生産、製品開発時のワーク特性分析に最適
- ・ポンピング、グロスリークテスト、ファインリークテストを1台で行います
- ・ヘリウムの充填時間、放置時間の管理が可能

対象ワーク

MEMSデバイス、リレーなど



小型電子部品専用気密検査装置 MSX-6200 series

NEW

- ・全自動リークテストシステム
- ・2016、2520サイズの測定が可能
- ・最小可検リーク量 $1 \times 10^{-9} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}(\text{He})$
- ・高速検査 0.8秒/1個

対象ワーク

SMD、SAWフィルタ、MEMSデバイスなど



ウルトラファインリークテストシステム MUH-0100 series

NEW

- ・ヘリウムガスによる超微小漏れ測定専用の装置
- ・漏れ判定レベル $4 \times 10^{-15} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}(\text{He})$
- ・最大ワークサイズ $\Phi 44 \times L 31 \text{mm}(\text{角} 30 \times 30)$

対象ワーク

MEMS部品(圧力センサ、加速度センサ、角速度センサ、
赤外線イメージセンサ)など

